

# 研究・開発に最適な 光応用製品



■ LCOS 型  
空間光変調器



■ 波長可変レーザー



■ 光学特性検査システム



■ 偏波測定



■ 計測システム



■ 波長可変フィルタ



皆様のご研究にお役立ていただける  
弊社製品のラインアップをウェブ  
サイトにも掲載しています。

製品情報の詳細は、  
裏面をご覧ください。

# 研究・開発に最適な光応用製品



## ■ 波長可変レーザー

### 最新ハイエンドモデル TSL-770



波長可変範囲 1480 to 1640 nm  
最速 200 nm/s で全域モードホップフリー掃引可能  
波長精度 0.5 pm、最大パワー +13 dBm、  
スペクトル線幅 60 kHz、周波数ゆらぎ 従来比 1/10 以下

### 最新スタンダードモデル TSL-570



2021年4月リリースの最新鋭機  
ご用途に合わせた波長帯や精度を選択可能  
波長精度 3 pm ~、最大パワー +13 dBm

### ハイパワーモデル TSL-570 Type H \* Preliminary



最大パワー +20 dBm  
波長可変範囲 1260 to 1360 nm or 1500 to 1630 nm  
シリコンフォトニクスなどの評価用光源に最適

### 超広帯域のフルバンドモデル Full-band TSL



波長可変範囲 1260 to 1680 nm (O to U-band)  
100 nm/s 波長掃引可能  
オペレーションソフトウェア付属

### ステップ可変エコノミーモデル WSL-110



最大 2 台のレーザーを搭載可能 (C or L-band)  
任意波長に設定可能

### 高速波長掃引型 VCSEL タイプ HSL-1



MEMS 技術と VCSEL 技術を融合  
中心波長 1060 nm、掃引速度可変 10 to 400 kHz  
LiDAR などのセンシング用光源に最適

### 高速波長掃引型 MEMS タイプ HSL-10/20



SS - OCT 用スタンダード光源  
中心波長 1060 nm or 1310 nm  
スキャンレンジ  $\geq 105$  nm

## ■ LCOS 型空間光変調器

### ハイスピードモデル SLM-210



反射型 LCOS で光の位相を自由に変調  
Full-HD 解像度、10-bit (1024 階調)  
優れた位相安定度 ( $-0.002\pi$  rad.)

### 紫外線耐性モデル SLM-250



液晶及び光学薄膜構造を耐紫外線に最適化  
波長範囲 365 to 550 nm

### 高出力耐性モデル SLM-300



液晶及び放熱構造を耐高出力レーザーに最適化  
対応波長 532 nm、800 nm、1064 nm

## ■ 光スイッチ

### 1xN、2xN メカニカルモデル SX1



低損出 <0.5 dB  
高い再現性  $\pm 0.005$  dB  
最大 360 ch まで対応  
8x8 などにもカスタマイズ可能  
タッチパネル採用による優れた操作性

## ■ 光アッテネータ

### 標準モデル OA1



最大ダイナミックレンジ 100 dB  
アッテネーション精度  $\pm 0.1$  dB  
高い再現性  $\pm 0.01$  dB  
Attn. 後のパワーモニタ機能 (オプション)

## ■ 光学特性検査システム

### スweepテストシステム

波長可変レーザー	TSL シリーズ
マルチポートパワーメータ	MPM シリーズ
偏波コントローラ	PCU-110
マルチプランチユニット	MBU

IL / WDL / PDL の効率的な測定を実現  
分岐ユニットにより更なる検査・評価の効率化が可能  
オペレーションソフトウェア付属



## ■ 波長可変フィルタ

### フィルタ形状可変 Top flat タイプ OTF-980



透過波長と帯域幅を可変  
非常に急峻なフィルタスロープ 1000 dB/nm  
エコノミーモデル (OTF-350 手動可変) も用意

### フィルタ形状 Gaussian タイプ OTF-930



豊富なフィルタ種類ラインアップ  
低 PDL (< 0.1 dB) & 低 PMD (< 0.1 ps)  
エコノミーモデル (OTF-320 手動可変) も用意

## ■ 偏波測定

### 偏光消光比モニタ PEM-340



偏光消光比、偏光角度、光強度を同時測定  
最大 50 dB までの消光比をリアルタイムに測定可能  
広い光入力範囲 (-40 to +20 dBm / 1260 to 1630 nm)

### 高消光比光源 PLS-100



0 から 180 度の間で偏光軸の角度を可変  
45 dB (代表値) の高消光比  
PMF デバイスの PER 測定に最適

## ■ 計測システム

### ラック・マウント型 PD アレイ MPA-100



高集積、コストパフォーマンスに優れた光パワー計測器  
当社製光部品 (タップ PD or Pigtail PD) を最大 80 ch 搭載  
多 ch 常時光パワーモニタや検査等に最適

### 光学距離計測 OFDR \* Preliminary



分解能 1  $\mu$ m で高速に光路長を計測  
シリコンフォトニクス (SiP)、フォトニック集積回路 (PIC) の  
ファイバ結合、デバイス内部の損失位置計測に最適  
詳細はお問い合わせください

### 光学式断層測定 (OCT) IVS シリーズ



波長掃引型 OCT (Swept-Source OCT) システム  
物の内部を非接触、非破壊、非侵襲で見ることが可能  
最大 30 fps のリアルタイム・イメージング

### 光学式三次元測定 OPS-1000



ダイナミックレンジ 70 dB 超高度 3D プロファイラー  
高分解能 0.2  $\mu$ m ~  
形状、材料、色、表面、外乱光の状態を問わず、  
非接触・高速測定が可能

## ■ 光パワーメータ

### マルチ ch モデル OP760/765



InGaAs タイプ 830 to 1700 nm  
Si (シリコン) タイプ 400 to 1100 nm  
交換式アダプタにより各種コネクタに対応  
タッチパネル採用による優れた操作性  
4ch ハーフラックタイプ有り (OP765)

www.santec.com